



检测报告



报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 1 页 共 41 页

委托单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位 无锡华润上华科技有限公司

受检单位地址 无锡市新吴区新洲路 8 号

样品类型 工业废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18842F52BE

报告说明

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 2 页 共 41 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 除客户特别声明本报告只适用于本次采集/收到的样品，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. “^”表示此信息有更改，本报告替换原报告 A2190339094113CQ001，自本报告签发之日起，原报告 A2190339094113CQ001 作废。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐鑫艳

签

发：

冯忆新

签发人姓名：

冯忆新

审

核：

胡文

签发日期：

2022/10/17

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 3 页 共 41 页

表 1:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-09			检测日期	2022-08-09~2022-08-12			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-001	氟化物	SUO22326001	0.29	8.45×10 ⁻³	24855	1.5	---	33.5
		SUO22326002	0.36					
		SUO22326003	0.36					
		平均值	0.34					
	氮氧化物	SUO22326013	ND	/	24447	50 ^a	---	
		SUO22326014	ND					
		SUO22326015	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUO22326007	2.29	3.64×10 ⁻²	24451	10	---	
		SUO22326008	0.54					
		SUO22326009	1.64					
		平均值	1.49					
	氯气	SUO22326010	1.1	2.73×10 ⁻²	24778	5.0	---	
		SUO22326011	1.0					
		SUO22326012	1.3					
		平均值	1.1					
	硫酸雾	SUO22326004	0.23	9.54×10 ⁻³	24451	5.0	---	
		SUO22326005	0.71					
		SUO22326006	0.23					
		平均值	0.39					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 4 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326001/ 011	22	5.9	100.4	1.3273	24843
SUO22326002	22	5.8	100.4	1.3273	24426
SUO22326003/ 012	23	6.0	100.4	1.3273	25295
SUO22326004/ 007/010/013	22	5.7	100.4	1.3273	24197
SUO22326005/ 008/014/015	21	5.8	100.4	1.3273	24572
SUO22326006/ 009	21	5.8	100.4	1.3273	24584
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-001 管道直径 1.30m, 采样孔位于弯道下游 360cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 5 页 共 41 页

表 2:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-09			检测日期	2022-08-09~2022-08-12			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-002	氟化物	SUO22326019	0.19	9.82×10 ⁻³	44638	1.5	---	33.5
		SUO22326020	0.22					
		SUO22326021	0.26					
		平均值	0.22					
	氮氧化物	SUO22326016	5	/	44030	50 ^a	---	
		SUO22326017	ND					
		SUO22326018	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUO22326025	1.39	4.55×10 ⁻²	44638	10	---	
		SUO22326026	0.49					
		SUO22326027	1.19					
		平均值	1.02					
	氯气	SUO22326028	0.8	3.96×10 ⁻²	44017	5.0	---	
		SUO22326029	1.1					
		SUO22326030	0.8					
		平均值	0.9					
	硫酸雾	SUO22326022	0.53	1.77×10 ⁻²	43244	5.0	---	
		SUO22326023	0.26					
		SUO22326024	0.45					
		平均值	0.41					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 6 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326016/ 020/026	26	11.0	100.0	1.3273	45435
SUO22326017/ 018/021/027	26	10.4	100.0	1.3273	43328
SUO22326019/ 025/028	26	10.8	100.1	1.3273	45151
SUO22326022	27	10.3	100.0	1.3273	42832
SUO22326023/ 029	27	10.3	100.1	1.3273	42955
SUO22326024/ 030	25	10.5	100.0	1.3273	43946
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-002 管道直径 1.30m, 采样孔位于变径处下游 360cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 7 页 共 41 页

表 3:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-09			检测日期	2022-08-09~2022-08-12			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-003	氟化物	SUO22326034	0.24	5.65 × 10 ⁻³	23526	1.5	---	33.5
		SUO22326035	0.26					
		SUO22326036	0.22					
		平均值	0.24					
	氮氧化物	SUO22326031	ND	7.28 × 10 ⁻²	24254	50 ^a	---	
		SUO22326032	6					
		SUO22326033	ND					
		平均值	3					
	氯化氢	SUO22326040	0.69	2.25 × 10 ⁻²	23945	10	---	
		SUO22326041	1.00					
		SUO22326042	1.14					
		平均值	0.94					
	氯气	SUO22326043	0.9	2.32 × 10 ⁻²	23238	5.0	---	
		SUO22326044	1.0					
		SUO22326045	1.1					
		平均值	1.0					
	硫酸雾	SUO22326037	0.39	1.75 × 10 ⁻²	23945	5.0	---	
		SUO22326038	0.48					
		SUO22326039	1.33					
		平均值	0.73					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 8 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326031/ 037/040/043	25	5.7	100.1	1.3273	23653
SUO22326032/ 033/038/041	25	5.9	100.1	1.3273	24555
SUO22326034/ 044	25	5.4	100.1	1.3273	22471
SUO22326035	26	5.9	100.1	1.3273	24515
SUO22326036/ 045	26	5.7	100.1	1.3273	23591
SUO22326039/ 042	26	5.7	100.1	1.3273	23626
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-003 管道直径 1.30m, 采样孔位于弯道下游 360cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“--”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 6.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 9 页 共 41 页

表 4:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-09			检测日期	2022-08-09~2022-08-12			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-004	氟化物	SUO22326049	0.24	5.33×10 ⁻³	23160	1.5	---	33.5
		SUO22326050	0.22					
		SUO22326051	0.22					
		平均值	0.23					
	氮氧化物	SUO22326046	ND	/	23410	50 ^a	---	
		SUO22326047	ND					
		SUO22326048	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUO22326055	0.57	1.34×10 ⁻²	23160	10	---	
		SUO22326056	0.55					
		SUO22326057	0.62					
		平均值	0.58					
	氯气	SUO22326058	1.2	2.37×10 ⁻²	23739	5.0	---	
		SUO22326059	1.0					
		SUO22326060	0.9					
		平均值	1.0					
	硫酸雾	SUO22326052	0.40	9.93×10 ⁻³	23082	5.0	---	
		SUO22326053	0.48					
		SUO22326054	0.40					
		平均值	0.43					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 10 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326046/ 047/049/055/ 058	34	5.8	100.0	1.3273	23647
SUO22326048/ 050/056	37	5.7	100.0	1.3273	22937
SUO22326051/ 057	36	5.7	100.0	1.3273	22897
SUO22326052	37	5.4	100.0	1.3273	21676
SUO22326053/ 059	38	6.0	100.5	1.3273	24174
SUO22326054/ 060	37	5.8	100.5	1.3273	23395
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-004 管道直径 1.30m, 采样孔位于变径处下游 360cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 11 页 共 41 页

表 5:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-10			检测日期	2022-08-10~2022-08-14			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-012	氟化物	SUO22326064	0.23	8.27×10 ⁻³	34467	1.5	---	33.5
		SUO22326065	0.25					
		SUO22326066	0.25					
		平均值	0.24					
	氮氧化物	SUO22326061	ND	/	34102	50 ^a	---	
		SUO22326062	ND					
		SUO22326063	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUO22326070	1.23	3.17×10 ⁻²	34467	10	---	
		SUO22326071	0.64					
		SUO22326072	0.90					
		平均值	0.92					
	氯气	SUO22326073	1.0	3.40×10 ⁻²	34003	5.0	---	
		SUO22326074	1.2					
		SUO22326075	0.9					
		平均值	1.0					
硫酸雾	SUO22326067	0.33	1.18×10 ⁻²	33821	5.0	---		
	SUO22326068	0.27						
	SUO22326069	0.46						
	平均值	0.35						

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 12 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326061/ 062/064/070/ 073	28	8.3	100.2	1.3273	34380
SUO22326063/ 065/071	29	8.1	100.2	1.3273	33547
SUO22326066/ 072	29	8.6	100.2	1.3273	35474
SUO22326067/ 074	29	8.4	100.2	1.3273	34675
SUO22326068	29	8.2	100.2	1.3273	33833
SUO22326069/ 075	30	8.0	100.2	1.3273	32954
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-012 管道直径 1.30m, 采样孔位于变径处下游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 13 页 共 41 页

表 6:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-10			检测日期	2022-08-10~2022-08-14			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-013	氟化物	SUO22326079	0.25	8.13×10 ⁻³	32515	1.5	---	33.5
		SUO22326080	0.26					
		SUO22326081	0.23					
		平均值	0.25					
	氮氧化物	SUO22326076	ND	/	32645	50 ^a	---	
		SUO22326077	ND					
		SUO22326078	ND					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUO22326085	0.94	3.58×10 ⁻²	32515	10	---	
		SUO22326086	1.62					
		SUO22326087	0.73					
		平均值	1.10					
	氯气	SUO22326088	1.3	3.77×10 ⁻²	31390	5.0	---	
		SUO22326089	1.0					
		SUO22326090	1.2					
		平均值	1.2					
	硫酸雾	SUO22326082	0.36	1.15×10 ⁻²	31097	5.0	---	
		SUO22326083	0.32					
		SUO22326084	0.44					
		平均值	0.37					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 14 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326076/ 077/079/085/ 088	27	7.8	100.2	1.3273	32329
SUO22326078/ 080/086	27	8.0	100.1	1.3273	33278
SUO22326081/ 087	27	7.7	100.1	1.3273	31938
SUO22326082/ 089	28	7.5	100.1	1.3273	31185
SUO22326083	28	7.6	100.1	1.3273	31450
SUO22326084/ 090	28	7.4	100.1	1.3273	30656
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-013 管道直径 1.30m, 采样孔位于变径处下游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 15 页 共 41 页

表 7:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-10			检测日期	2022-08-10~2022-08-14			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-010	氟化物	SUO22326094	0.23	1.16×10 ⁻²	50418	1.5	---	33.5
		SUO22326095	0.23					
		SUO22326096	0.24					
		平均值	0.23					
	氮氧化物	SUO22326091	ND	/	49620	50 ^a	---	
		SUO22326092	ND					
		SUO22326093	4					
		平均值	ND					
	氯化氢	SUO22326100	1.58	5.28×10 ⁻²	49768	10	---	
		SUO22326101	0.48					
		SUO22326102	1.13					
		平均值	1.06					
	氯气	SUO22326103	0.9	4.01×10 ⁻²	50179	5.0	---	
		SUO22326104	0.9					
		SUO22326105	0.7					
		平均值	0.8					
	硫酸雾	SUO22326097	ND	1.24×10 ⁻²	49768	5.0	---	
		SUO22326098	0.27					
		SUO22326099	0.37					
		平均值	0.25					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 16 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326091/ 097/100/103	23	11.8	100.4	1.3273	49604
SUO22326092/ 093/098/101	23	11.8	100.4	1.3273	49628
SUO22326094	23	12.0	100.4	1.3273	50320
SUO22326095/ 104	22	12.0	100.4	1.3273	50639
SUO22326096/ 105	23	12.0	100.4	1.3273	50295
SUO22326099/ 102	23	11.9	100.4	1.3273	50071
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-010 管道直径 1.30m, 采样孔位于弯道下游 360cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 6.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 7.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 17 页 共 41 页

表 8:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-10			检测日期	2022-08-10~2022-08-14			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-014	氟化物	SUO22326109	0.40	1.35×10 ⁻²	34620	1.5	---	33.5
		SUO22326110	0.37					
		SUO22326111	0.39					
		平均值	0.39					
	氮氧化物	SUO22326106	3	0.132	32922	50 ^a	---	
		SUO22326107	4					
		SUO22326108	4					
		平均值	4					
	氯化氢	SUO22326115	0.58	2.27×10 ⁻²	33347	10	---	
		SUO22326116	0.54					
		SUO22326117	0.92					
		平均值	0.68					
	氯气	SUO22326118	0.8	3.05×10 ⁻²	33896	5.0	---	
		SUO22326119	1.1					
		SUO22326120	0.9					
		平均值	0.9					
	硫酸雾	SUO22326112	0.63	1.23×10 ⁻²	33347	5.0	---	
		SUO22326113	0.39					
		SUO22326114	ND					
		平均值	0.37					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 18 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326106/ 107/112/115/ 118	24	7.9	100.1	1.3273	33029
SUO22326108/ 113/116	23	7.8	100.1	1.3273	32707
SUO22326109	23	8.4	100.1	1.3273	35200
SUO22326110/ 119	23	8.2	100.1	1.3273	34373
SUO22326111/ 120	24	8.2	100.1	1.3273	34286
SUO22326114/ 117	24	8.2	100.1	1.3273	34306
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.FQ-014 管道直径 1.30m, 采样孔位于弯道下游 430cm, 采样孔直径 10cm。 2.a 表示适用于酸洗、薄膜等工段产生的工艺废气。 3.氮氧化物为现场检测。 4.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 5.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 6.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 19 页 共 41 页

表 9:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-09			检测日期	2022-08-10			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-005	氨	SUO22326121	ND	6.12×10 ⁻³	19735	10	---	33.5
		SUO22326122	ND					
		SUO22326123	0.67					
		平均值	0.31					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326121	30	8.1	100.0	0.7854	19655			
SUO22326122	29	8.0	100.0	0.7854	19434			
SUO22326123	30	8.3	100.0	0.7854	20117			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.FQ-005 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 4.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 20 页 共 41 页

表 10:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-09			检测日期	2022-08-10			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-006	氨	SUO22326124	ND	/	21102	10	---	33.5
		SUO22326125	ND					
		SUO22326126	ND					
		平均值	ND					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326124	35	8.8	100.0	0.7854	21069			
SUO22326125	35	9.0	100.0	0.7854	21508			
SUO22326126	36	8.7	100.0	0.7854	20728			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.FQ-006 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 21 页 共 41 页

表 11:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-10			检测日期	2022-08-11			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-016	氨	SUO22326127	ND	/	20708	10	---	33.5
		SUO22326128	ND					
		SUO22326129	0.34					
		平均值	ND					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326127	23	8.5	100.1	0.7854	21211			
SUO22326128	23	8.1	100.1	0.7854	20237			
SUO22326129	24	8.3	100.1	0.7854	20676			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.FQ-016 管道直径 1.00m, 采样孔位于变径处下游 400cm, 采样孔直径 10cm。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 22 页 共 41 页

表 12:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-10			检测日期	2022-08-11			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-011	氨	SUO22326130	ND	/	11689	10	---	33.5
		SUO22326131	ND					
		SUO22326132	ND					
		平均值	ND					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326130	24	4.7	100.1	0.7854	11654			
SUO22326131	23	4.7	100.1	0.7854	11686			
SUO22326132	22	4.7	100.1	0.7854	11728			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.FQ-011 管道直径 1.00m, 采样孔位于弯道下游 400cm, 采样孔直径 10cm。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 23 页 共 41 页

表 13:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-12			检测日期	2022-08-12~2022-08-18			
采样方式	连续/瞬时			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-052	二氧化硫	SUO22326577	ND	/	27177	^50	^---	33.5
		SUO22326578	ND					
		SUO22326579	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUO22326577	9	0.190	27177	^150	^---	
		SUO22326578	5					
		SUO22326579	7					
		平均值	7					
	颗粒物	SUO22326145	3.7	8.98×10 ⁻²	27216	^20	^---	
		SUO22326146	3.2					
		SUO22326147	3.1					
		平均值	3.3					
	异丙醇	SUO22326142	ND	1.10×10 ⁻⁴	27394	40	---	
		SUO22326143	ND					
		SUO22326144	0.009					
		平均值	0.004					
	非甲烷总 烃	SUO22326139	1.07	4.05×10 ⁻²	27394	50	---	
		SUO22326140	1.68					
		SUO22326141	1.68					
		平均值	1.48					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 24 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326139 /140/142/143/ 145	58	12.5	100.1	0.7854	27502
SUO22326141 /144/146	58	12.3	100.0	0.7854	27177
SUO22326147	57	12.2	100.0	0.7854	26968
参照标准	^二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 客户提供限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 ^4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 25 页 共 41 页

表 14:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-12			检测日期	2022-08-12~2022-08-18			
采样方式	连续/瞬时			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-023	二氧化硫	SUO22326148	ND	/	19524	^150	^---	33.5
		SUO22326149	ND					
		SUO22326150	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUO22326148	ND	/	19524	^50	^---	
		SUO22326149	ND					
		SUO22326150	ND					
		平均值	ND					
	颗粒物	SUO22326157	3.5	6.30×10 ⁻²	19084	^20	^---	
		SUO22326158	3.2					
		SUO22326159	3.1					
		平均值	3.3					
	异丙醇	SUO22326154	ND	/	19524	40	---	
		SUO22326155	0.003					
		SUO22326156	ND					
		平均值	ND					
	非甲烷总 烃	SUO22326151	1.35	3.42×10 ⁻²	19524	50	---	
		SUO22326152	2.15					
		SUO22326153	1.76					
		平均值	1.75					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 26 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326148 /149/151/152/ 154/155/157	68	9.1	100.0	0.7854	19522
SUO22326150 /153/156/158	68	9.1	100.0	0.7854	19528
SUO22326159	68	8.5	99.9	0.7854	18202
参照标准	^二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 客户提供限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 ^4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 27 页 共 41 页

表 15:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-12			检测日期	2022-08-12~2022-08-18			
采样方式	连续/瞬时			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-025	二氧化硫	SUO22326160	ND	/	16393	^50	^---	33.5
		SUO22326161	ND					
		SUO22326162	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUO22326160	ND	/	16393	^150	^---	
		SUO22326161	ND					
		SUO22326162	ND					
		平均值	ND					
	颗粒物	SUO22326169	3.5	5.66×10 ⁻²	16647	^20	^---	
		SUO22326170	3.4					
		SUO22326171	3.3					
		平均值	3.4					
	异丙醇	SUO22326166	ND	1.15×10 ⁻⁴	16472	40	---	
		SUO22326167	0.013					
		SUO22326168	0.006					
		平均值	0.007					
	非甲烷总 烃	SUO22326163	1.07	2.65×10 ⁻²	16472	50	---	
		SUO22326164	1.89					
		SUO22326165	1.88					
		平均值	1.61					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 28 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326160 /161/162/163/ 164/166/167/ 169	70	7.7	100.2	0.7854	16393
SUO22326165 /168/170	69	7.8	100.2	0.7854	16629
SUO22326171	69	7.9	100.2	0.7854	16919
参照标准	^二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 客户提供限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 ^4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 29 页 共 41 页

表 16:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-12			检测日期	2022-08-12~2022-08-18			
采样方式	连续/瞬时			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-053	二氧化硫	SUO22326172	ND	/	18213	^50	^---	33.5
		SUO22326173	ND					
		SUO22326174	ND					
		平均值	ND					
	氮氧化物	SUO22326172	4	5.46×10 ⁻²	18213	^150	^---	
		SUO22326173	4					
		SUO22326174	ND					
		平均值	3					
	颗粒物	SUO22326181	2.9	5.85×10 ⁻²	17727	^20	^---	
		SUO22326182	3.5					
		SUO22326183	3.5					
		平均值	3.3					
	异丙醇	SUO22326178	0.006	1.26×10 ⁻⁴	17940	40	---	
		SUO22326179	0.013					
		SUO22326180	ND					
		平均值	0.007					
	非甲烷总 烃	SUO22326175	1.13	2.46×10 ⁻²	17940	50	---	
		SUO22326176	1.29					
		SUO22326177	1.68					
		平均值	1.37					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 30 页 共 41 页

续上表

烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326172 /173/174/177/ 180/182	64	8.4	100.3	0.7854	18213
SUO22326175 /176/178/179/ 181	65	8.2	100.3	0.7854	17803
SUO22326183	64	7.9	100.3	0.7854	17165
参照标准	^二氧化硫、氮氧化物、颗粒物: 客户提供限值 异丙醇、非甲烷总烃: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3				
备注: 1.氮氧化物、二氧化硫为现场检测。 2.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 3.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 ^4.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 和客户提供限值中未对该项目作限制。 5.排气筒高度由受检单位提供。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 31 页 共 41 页

表 17:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	李小峰、袁骏			
采样日期	2022-08-13			检测日期	2022-08-14~2022-08-15			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ-021	氯化氢	SUO22326184	0.92	8.54×10 ⁻³	6726	10	---	25
		SUO22326185	0.89					
		SUO22326186	2.00					
		平均值	1.27					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326184/ 185/186	30	4.3	100.5	0.5027	6726			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 2.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 32 页 共 41 页

表 18:

样品信息:					
样品类型	工业废气 (有组织)		采样人员	李小峰、袁骏	
采样日期	2022-08-12		检测日期	2022-08-12~2022-08-13	
采样方式	瞬时		样品状态	完好	
检测结果:					
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h
有机入口 1(FQ-023, FQ-025)	非甲烷总烃	SUO22326406	31.7	1.09	33330
		SUO22326407	32.8		
		SUO22326408	34.0		
		平均值	32.8		
烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO22326406/ 407/408	40	4.4	100.0	2.5447	33330
备注: 有机入口 1(FQ-023,FQ-025)管道直径 1.80m, 采样孔位于弯道下游 220cm, 采样孔直径 10cm。					

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 33 页 共 41 页

表 19:

样品信息:					
样品类型	工业废气 (有组织)		采样人员	陈冠宇、查义强	
采样日期	2022-08-12		检测日期	2022-08-12~2022-08-13	
采样方式	瞬时		样品状态	完好	
检测结果:					
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流量 m ³ /h
有机入口 2 (FQ- 052,FQ- 053)	非甲烷总烃	SUO22326418	33.2	1.37	39237
		SUO22326419	21.6		
		SUO22326420	50.1		
		平均值	35.0		
烟气参数:					
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h
SUO223264418 /419/420	41	5.2	99.9	2.5447	39237

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 34 页 共 41 页

表 20:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-13			检测日期	2022-08-14~2022-08-15			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ049	氯化氢	SUO22326616	1.66	5.81×10 ⁻³	2982	10	---	33.5
		SUO22326617	1.76					
		SUO22326618	2.42					
		平均值	1.95					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326616	32	3.4	100.2	0.2827	2965			
SUO22326617	33	3.3	100.2	0.2827	2863			
SUO22326618	33	3.6	100.2	0.2827	3119			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 2.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 35 页 共 41 页

表 21:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)			采样人员	陈冠宇、查义强			
采样日期	2022-08-13			检测日期	2022-08-15			
采样方式	连续			样品状态	完好			
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ050	氨	SUO22326619	ND	/	3546	10	---	33.5
		SUO22326620	ND					
		SUO22326621	ND					
		平均值	ND					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326619	34	4.2	100.2	0.2827	3630			
SUO22326620	34	3.9	100.2	0.2827	3383			
SUO22326621	35	4.2	100.2	0.2827	3625			
参照标准	《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1.“ND”表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 2.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3.“---”表示 DB 32/3747-2020 表 3 标准中未对该项目作限制。 4.排气筒高度由受检单位提供。								

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 36 页 共 41 页

表 22:

样品信息:								
样品类型	工业废气 (有组织)		采样人员	陈冠宇、查义强				
采样日期	2022-08-13		检测日期	2022-08-13~2022-08-15				
采样方式	连续/瞬时		样品状态	完好				
检测结果:								
点位名称	检测项目	样品编号	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h	标干流 量 m ³ /h	参照标准限值		排气 筒高 度 m
						排放浓 度 mg/m ³	排放 速率 kg/h	
FQ051	硫化氢	SUO22326628	ND	/	1860	---	1.8	33.5
		SUO22326629	ND	/	1763			
		SUO22326630	ND	/	1903			
		最大值	ND	/	1903			
	氨	SUO22326622	ND	/	1842	10	---	
		SUO22326623	ND					
		SUO22326624	ND					
		平均值	ND					
	臭气浓度	SUO22326625	97 (无量纲)		15000 (无量纲)	15000 (无量纲)		
		SUO22326626	130 (无量纲)					
		SUO22326627	97 (无量纲)					
		最大值	130 (无量纲)					
烟气参数:								
烟气参数	烟温 °C	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m ²	标干流量 m ³ /h			
SUO22326622 /625/628	41	3.9	100.2	0.1590	1860			
SUO22326623 /626/629	42	3.7	100.2	0.1590	1763			
SUO22326624 /627/630	42	4.0	100.2	0.1590	1903			
参照标准	硫化氢、臭气浓度: 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 2 恶臭污染物排放标准值 氨: 《半导体行业污染物排放标准》(DB 32/3747-2020) 表 3							
备注: 1. "ND"表示未检出, 涉及项目检出限详见表 24。 2. "/"表示检测项目的排放浓度小于检出限, 故排放速率无需计算。 3. "---"表示 DB 32/3747-2020 表 3 和 GB 14554-1993 表 2 标准中未对该项目作限制。 4. 排气筒高度由受检单位提供。								

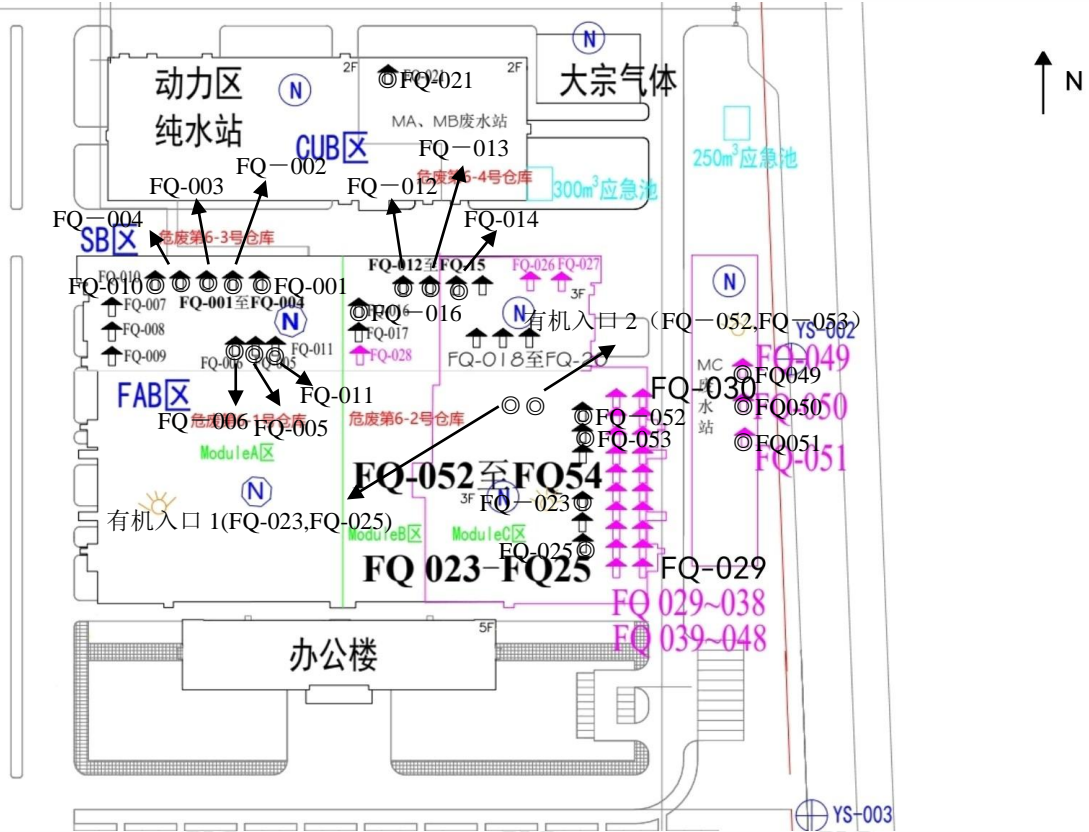
本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 37 页 共 41 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气有组织采样点

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 38 页 共 41 页

表 23:

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	氟化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
		离子计	PXSJ-216F	TTE20213340	2022-10-19
	颗粒物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
		恒温恒湿称量设备	WZZ-M	TTF20191083	2022-11-04
	二氧化硫	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
	氮氧化物	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 39 页 共 41 页

续上表

仪器信息:					
检测项目	对应仪器				
	名称	型号	实验室编号	检校有效期	
工业废气 (有组织)	氯化氢	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20120654	2023-04-14
		智能双路烟气采样器	崂应 3072(02 代)	TTE20151653	2023-05-31
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2023-07-21
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212465	2022-09-01
	硫酸雾	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20141126	2023-03-31
		离子色谱仪 (IC)	Aquion	TTE20164915	2023-07-21
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
	氯气	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		双路 VOCs 采样器	ZR-3710B 型	TTE20191316	2023-05-09
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
		双路 VOCs 采样器	ZR-3713	TTE20202194	2023-01-02
		紫外可见分光光度计 (UV)	UV-7504	TTE20213126	2022-10-11

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 40 页 共 41 页

续上表

仪器信息:					
检测项目		对应仪器			
		名称	型号	实验室编号	检校有效期
工业废气 (有组织)	非甲烷总 烃	气相色谱仪(GC)	GC-2014	TTE20172480	2023-03-15
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
	硫化氢	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212465	2022-09-01
		紫外可见分光光度计(UV)	UV-7504	TTE20213126	2022-10-11
	氨	智能双路烟气采样器	崂应 3072(02代)	TTE20151653	2023-05-31
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		大流量自动烟尘气采样器	ZR-3260D	TTE20178216	2022-12-02
		双路烟气采样器	ZR-3712	TTE20212465	2022-09-01
		紫外可见分光光度计(UV)	UV-7504	TTE20213126	2022-10-11
	异丙醇	气相色谱质谱联用仪(GCMS)	QP-2010Ultra	TTE20150799	2023-04-19
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20175241	2022-10-11
		双路 VOCs 采样器	ZR-3710B 型	TTE20191316	2023-05-09
		自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	TTE20200006	2023-01-04
		双路 VOCs 采样器	ZR-3713	TTE20202194	2023-01-02

本页完

检测结果

报告编号 A2190339094113CQa001R1

第 41 页 共 41 页

表 24:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
工业废气 (有组织)	氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	0.06mg/m ³
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016	0.2mg/m ³
	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T 30-1999	0.2mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(国家环保总局 2003 年 第四版) 第五篇 第四章 十 (三)	0.01mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	/
	异丙醇	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.002mg/m ³

报告结束